



Инфракрасный инспекционный микроскоп KIR-6120



Инфракрасный инспекционный микроскоп KIR-6120 предназначен для проведения неразрушающего контроля полупроводниковых приборов, в частности для выполнения анализа отказов после операции монтажа флип-чипов.

Особенности модели:

- Неразрушающий контроль WLCSP-компонентов
- Неразрушающий контроль качества монтажа флип-чипов
- Контроль интерметаллических соединений AuAl после операции разварки кристаллов и бампинга
- Исследование трехмерных структур MEMS
- Контроль качества полировки структур «кремний на изоляторе» (SOI)
- Возможность работы с пластинами диаметром до 300 мм
- Контроль целостности структур благодаря системе обработки ИК-изображений
- Контроль качества межсоединений, недоступных для визуального контроля

Параметры	KIR-6120
Увеличение	50x–500x (максимум 1000x)
Окуляры	PL10X / 25 мм широкоугольные с вынесенной точкой фокусировки
Головка микроскопа	Триокулярная, 0–35°
Расстояние между окулярами	50–76 мм
Объективы	NIR 5x, 10x, 20x, 50x, 100x (Nikon, Mitutoyo, Edmond)
Револьверная головка	BD Sextuple
Корпус	Рефлектор; коаксиальная грубая и точная настройка (ход грубой настройки 33 мм, точность настройки 0,001 мм, встроенный трансформатор 100–240 В)
Подсветка	Отраженный источник света с ирисовой и апертурной диафрагмами; слоты для фильтра и поляризатора; галогенная лампа 12 В / 100 Вт
Рабочий столик	300 x 350 мм, с зажимом
Перемещение	356 x 305 мм
Адаптер для камеры	0,5x / 0,56x / 1x; С-крепление; настраиваемый фокус
Двойное С-крепление для камер	Для переключения между режимами обычного микроскопа и ИК-микроскопа

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники